



# 半導体産業用圧力計

Pressure Gauge for Semiconductor Industry

## 概要

半導体高純度ガス、及び腐食性ガスの雰囲気等の条件下でも優れた性能を発揮します。

気密性・洗浄度に対しても充分考慮して製作されており、半導体プロセス等、特に高純度流体向けに適した圧力計です。


## 特長

- ・ブルドン管・株・ケース・内機等主要部品がステンレス製ですので、測定体はもちろん、雰囲気に対しても耐食性に優れています。
- ・圧力エレメント等の接液部の溶接は、アルゴンアーク溶接を行い、さらに耐圧・気密検査の実施等、厳重な品質管理の下で製作しております。

※ 圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30～65%範囲内で使われるように圧力レンジを選定してください。また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。

## 製作仕様

測定流体：  
気体又は液体

形状：  
埋込形…  D 枠（中心裏ネジ、ステム）

大きさ：  
φ50

接続ネジ：  
1/4 TUBE

接液部材質：  
ブルドン管・株 EPグレード：SUS316L  
BAグレード：SUS316L  
ケース SUS304（生地）  
内機 SUS製

溶接方法：  
アルゴンアーク溶接

圧力レンジ：  
0～0.4→0～3.5MPa  
-0.1～0.3→0.1～2MPa

精度：  
±3%F.S.

気密性（He真空法）：  
EPグレード： $1.01 \times 10^{-9}$  Pa・m<sup>3</sup>/s以下  
BAグレード： $1.01 \times 10^{-9}$  Pa・m<sup>3</sup>/s以下

洗浄度：  
EPグレード：0.2μm以上のパーティクル10個以下  
BAグレード：クラスIV（ANSI B40、1M-1979）

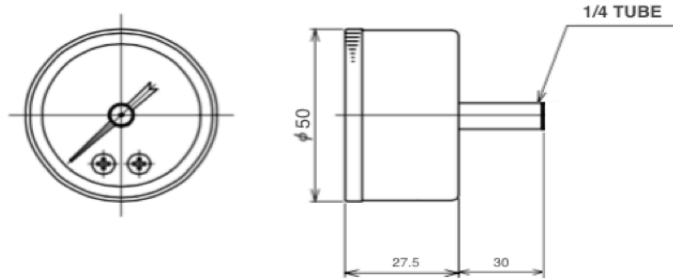
## グレード構成

グレード	EPグレード	BAグレード
接液部材質	SUS316L (接ガス面研磨)	SUS316L
洗浄度	0.2μm以上の パーティクル10個以下	クラスIV (ASME B40.7-1998)
漏れ検査	$1.01 \times 10^{-9}$ Pa・m <sup>3</sup> /s以下	
洗浄	① 粗洗浄 ② 超音波洗浄 ③ 仕上げ洗浄 ④ N <sub>2</sub> ガスフラッシング	
作業場所	① 一般作業場所 ② クリーンルーム（クラス10,000） ③ クリーンベンチ（クラス100）	
調整検査媒体	N <sub>2</sub> ガス	
梱包形態	ポリエチレン袋密封	

外形寸法

構造図

PG-V-4TS-C-N



形番構成 ご用命に際しては、形番、各仕様及び圧力レンジをご指定下さい

(注：本機種においてX印の桁には仕様項目がありませんが、ご用命の際はXでご指定下さい。)

PG				1				0	0	0	X	X	X	X	X	X	X		
				①	②	③		④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮

半導体産業用圧力計  
BA,EPグレード

モデル		選択仕様	付加仕様(オプション)
モデル		形式	
		φ50 埋込形	
① 形状	1	D枠(中心裏、ネジ、ステム)	
② 接続ネジ		1/4 TUBE	
③ 接液	3	SUS316L:BAグレード	
	4	SUS316L:EPグレード	
④ 圧力レンジ(MPa)	1	-0.1 ~ 0.3, 0.4, 0.6, 1, 1.5, 2	
	2	0 ~ 0.4, 0.6, 1, 1.5, 2, 2.5, 3.5	
		(ご注文に際してはレンジと単位を別途ご指定下さい。)	
⑤ 性能	0	標準(±3.0% F.S.)	
⑥ 指針	0	標準形	
⑦ ガラス	0	標準	

⑮ドキュメント

0	ナシ
1	アリ (ご希望のものを別途ご指示下さい。) 提出図、取扱説明書、検査要領書 検査成績表(1個1部) トレサビリティ証明書、校正証明書 強度計算書、立会検査